

■概要

特徴

MEMS技術により作製された、透過電子顕微鏡 (TEM) 用歪み測定試料です。

薄膜の中央部に最小で直径数十 nm の孔をアレイ状に形成しております。本試料から得られたTEM像を解析することで、TEM像に含まれる歪みを精度良く測定することができます。

支援方法

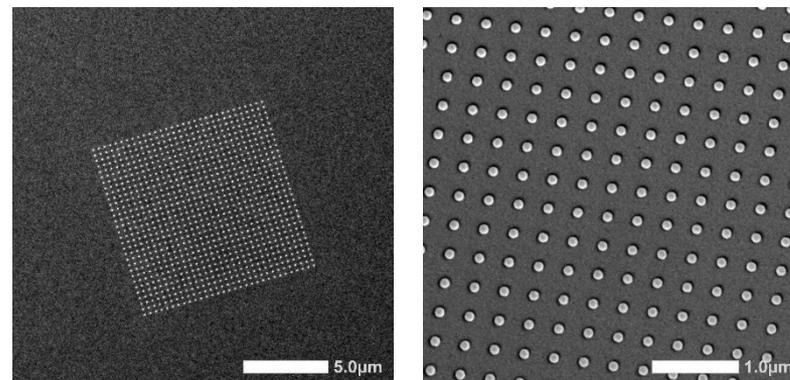
ものづくり企業技術開発支援共同研究

開発時期

平成29年4月～平成30年3月

担当

電子情報システム部



歪み測定試料

■企業情報

企業名

日本電子株式会社
日本電子山形株式会社

所在地

東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号
山形県天童市大字山口字大仏1655

TEL

023-658-2811 042-543-1111

URL

<https://www.jeol.co.jp/>

事業内容

電子顕微鏡及び医用機器製品の開発、製造

■支援技術の概要



ドライエッチング装置

日本電子株式会社が有する電子顕微鏡技術、高精細電子ビーム制御技術と、工業技術センターが有するMEMS技術が融合してできた開発事例です。

フォトリソグラフィとドライエッチングを用いて、数十nmの孔を薄膜上に精度よく形成しました。